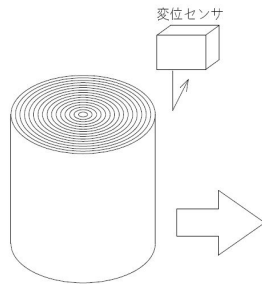


例) 積層面ズレ検査測定器

<概略>

積層ワークの積層ズレ状態、ロール状ワークの巻ズレ状態等の測定を行います。

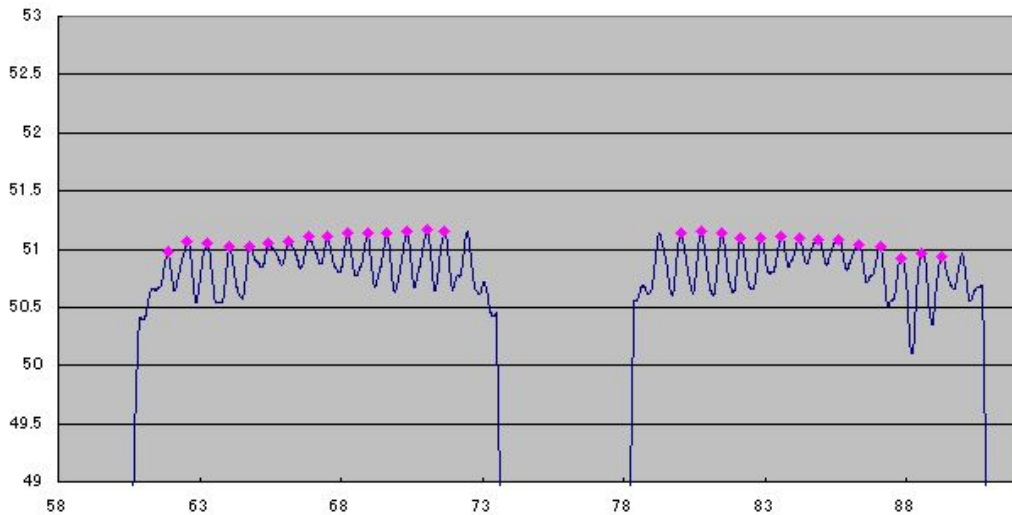


測定センサ(反射式レーザ変位センサ等)が測定面を走査します。

サンプリング周期 1ms~100msでデータを収集します。

サンプリングデータより、積層端面を抽出し、MAX-MIN判定、平均値算出、標準偏差判定等を行います。

ワークに合わせた各種補正も組み込み可能です。(傾き補正等)



上位システムに対しては、判定結果、判定データ、検出端面位置情報、検出端面高さ情報を報告します。

<測定に関する設定パラメータ(抜粋)>

- ・走査動作に関するパラメータ(速度、加減速、早送り速度、等)
- ・センサデータ収集に関するパラメータ(サンプリング周期、スケール・オフセット調整、移動平均等)
- ・各検出条件パラメータ
- ・検査判定設定

<対応実装インターフェース>

- ・パラレル I/O
- ・三菱PLC Qシリーズ Ether接続(簡易PLCリンク)
- ・三菱PLC Qシリーズ シリアル接続(MCプロトコル)
- ・OMRON シーケンサ シリアル接続(FINSコマンド)
- ・PANASONICシーケンサ シリアル接続(専用プロトコル)
- ・KYENCE シーケンサEther接続(簡易PLCリンク)
- ・KYENCEシーケンサ シリアル接続(MCプロトコル)

ステータス、モニタ値参照、設定値セット等がシーケンサからプログラムレスで行えます。